PAT-NO: JP02000102886A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2000102886 A

TITLE: LASER CONTROL DEVICE

PUBN-DATE: April 11, 2000

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY HARA, KAZUHIKO N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY MITSUBISHI ELECTRIC CORP N/A

APPL-NO: JP10275130

APPL-DATE: September 29, 1998

INT-CL (IPC): <u>B23K026/00</u>, <u>B23K026/06</u> , <u>B23K026/08</u>

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a \underline{laser} control device for efficiently shortening a radiation control time without deteriorating radiation accuracy of a light beam.

SOLUTION: This device comprises a <u>laser</u> device 1 for ejecting a <u>laser</u> light 2, a light coupling device 3 for dividing the <u>laser</u> light into <u>plural light</u> beams 6 and condensing the beams, <u>plural</u> optical fibers 4 for transmitting the light <u>beams ejected from the light coupling device</u>, <u>plural switches</u> 10 which are inserted into an intermediate part of each optical fiber and optionally open/close an optical path of the light beam, a bundle fiber 9 for constituting ejection ports of the optical fibers in a given arrangement, and a transfer optical system 7 for radiating the light beams ejected from each ejection port onto a target object 8. In this case, the ejection port of each optical fiber is positioned by the bundle fiber, and the radiation shape of the light beam is formed by the arrangement of the ejection ports. Additionally, the switches for optionally opening/closing the passing of the light beam are installed at the intermediate part of each optical fiber, so that the light beams corresponding to a given code are radiated.

COPYRIGHT: (C)2000, JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-102886 (P2000-102886A)

(43)公開日 平成12年4月11日(2000.4.11)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
B 2 3 K	26/00		B 2 3 K	26/00	M	4E068
	26/06			26/06	J	
					С	
	26/08			26/08	K	

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 10 頁)

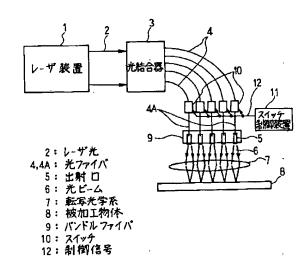
		田里明水	木明水 明水丸の数II OL (主 IO 貝)
(21)出願番号	特顧平10-275130	(71)出顧人	000006013 三菱電機株式会社
(22)出顧日	平成10年9月29日(1998.9.29)	(72)発明者 (74)代理人 Fターム(参	東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三 菱電機株式会社内

(54) 【発明の名称】 レーザ制御装置

(57)【要約】

【課題】 光ビームの照射精度を損なうことなく効果的 に照射制御時間を短縮することのできるレーザ制御装置 を得る。

【解決手段】 レーザ光2を出射するレーザ装置1と、レーザ光を複数の光ビーム6に分割して集光するための光結合器3と、光結合器から出射される光ビームを伝送する複数の光ファイバ4と、各光ファイバの中間部に挿入されて光ビームの光路を選択的に開閉する複数のスイッチ10と、光ファイバの出射口を所定配列に構成するためのバンドルファイバ9と、各出射口から出射された光ビームを目標物体8に照射するための転写光学系7とを備え、各光ファイバの出射口をバンドルファイバで位置決めして、光ビームの照射形状を出射口の配列により形成するとともに、各光ファイバの中間部に光ビームの通過を選択的に開閉するスイッチを設けて任意の記号に対応した光ビームを照射する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 レーザ光を出射するレーザ装置と、

前記レーザ光を複数の光ビームに分割して集光するため の光結合器と、

前記光結合器から出射される光ビームを伝送する複数の 光ファイバと、

前記各光ファイバの中間部に挿入されて前記光ビームの 光路を選択的に開閉する複数のスイッチと、

前記光ファイバの出射口を所定配列に構成するためのバ ンドルファイバと、

前記各出射口から出射された光ビームを目標物体に照射 するための転写光学系とを備えたレーザ制御装置。

【請求項2】 前記各スイッチを個別に開閉駆動するた めのスイッチ制御装置を備え、

前記スイッチ制御装置は、前記各スイッチの制御情報が 格納された記憶手段を有し、前記制御情報に応じた制御 信号を出力すること特徴とする請求項1に記載のレーザ 制御装置。

【請求項3】 前記バンドルファイバは、前記光ファイ バの出射口を1次元的に配列したことを特徴とする請求 20 項1または請求項2に記載のレーザ制御装置。

【請求項4】 前記バンドルファイバは、前記光ファイ バの出射口を2次元的に配列したことを特徴とする請求 項1または請求項2に記載のレーザ制御装置。

【請求項5】 前記バンドルファイバは、複数のバンド ルファイバに分割されたことを特徴とする請求項3また は請求項4に記載のレーザ制御装置。

【請求項6】 前記各スイッチは、

前記光ビームの光路中に選択的に配置される遮光板と、 前記遮光板を駆動する駆動手段とを有することを特徴と 30 する請求項1から請求項5までのいずれかに記載のレー ザ制御装置。

【請求項7】 前記遮光板は、前記光ビームの照射面が 全反射ミラーからなり、前記光ビームの光路中に所定角 度をもって選択的に配置され、

前記駆動手段は、前記遮光板の回転軸となる回転シャフ トと、前記回転シャフトを介して前記遮光板を回転駆動 するモータとを有することを特徴とする請求項6に記載 のレーザ制御装置。

射口の所定配列に対応するように一体的に配列されたこ とを特徴とする請求項1から請求項7までのいずれかに 記載のレーザ制御装置。

【請求項9】 前記光結合器は、前記光ファイバの出射 口の所定配列に対応した配列からなる単一のレンズアレ イを有し、

前記各光ファイバの入射口は、前記レンズアレイの集光 点に配置されたことを特徴とする請求項1から請求項8 までのいずれかに記載のレーザ制御装置。

ことを特徴とする請求項1から請求項9までのいずれか に記載のレーザ制御装置。

【請求項11】 前記目標物体は、表示用のスクリーン からなることを特徴とする請求項1から請求項9までの いずれかに記載のレーザ制御装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、たとえば、複数 の光ファイバを介して伝送されたレーザ光のビームを物 10 体に照射するレーザ制御装置に関し、特に光ビームの出 射口の配列を改良するとともに、光ビームの通過を開閉 するスイッチの配置を改良することにより、高精度で高 速なビーム照射を実現したレーザ制御装置に関するもの である。

[0002]

【従来の技術】従来より、YAGレーザ、半導体レー ザ、銅蒸気レーザ、エキシマレーザなどは、光ファイバ を介して伝送可能な発振波長(赤外線領域、可視光線領 域または紫外線領域)のレーザ光を出射するので、高精 度の照射位置制御が要求されるレーザ光制御装置に用い られている。

【0003】この種のレーザ制御装置は、レーザ伝送光 学系としてミラーなどの光学部品を用いる必要がなく、 光ファイバを介してレーザ光を自由に目標物体(たとえ ば、被加工物体)まで伝送することができるので、穴あ け、溶接、切断などの加工に広く適用されている。

【0004】すなわち、単一の光ビームで加工する場合 には、光ファイバの出射口を移動させて、被加工物体に 対する光ビームの照射位置をスキャンさせる。また、複 数の光ビームで加工する場合は、バンドルファイバを介 して配列された光ファイバの出射口にスイッチを設け、 各光ビームの出射を選択的に開閉させる。

【0005】図11は、たとえば、「サード・シンポジ ウム・オン・マイクロジョイニング・アンド・アセンブ リ・テクノロジ・イン・エレクトロニクス(3rd S ymposium on "Microjoining and AssemblyTechnnology in Electronics")」の「樹脂プリント 基板用エキシマレーザ多軸穴明け加工装置」(1997 【請求項8】 前記各スイッチは、前記光ファイバの出 40 年2月6日~7日、第173頁~第178頁)に記載さ れた従来のレーザ制御装置を概略的に示す構成図であ り、複数の光ビームで被加工物体を加工する場合を示し ている。

【0006】図11において、1はレーザ光2を出射す るレーザ装置であり、YAGレーザ、半導体レーザ、銅 蒸気レーザ、エキシマレーザなどにより構成されてい る。3はレーザ光2を複数の光ビーム6に分割して集光 するための光結合器、4は各光ビーム6を伝送する光フ ァイバ、5は光ビーム6を出射する光ファイバ4の出射 【請求項10】 前記目標物体は、被加工物体からなる 50 口、7は出射口5から出射された光ビーム6を被加工物

体8に照射するための転写光学系である。

【0007】次に、図11に示した従来のレーザ制御装置の動作について説明する。なお、ここでは、図示しないが、光ファイバ4の入射側には、各光ファイバ4を配列するためのバンドルファイバ(図示せず)が設けられており、光ファイバ4の出射側には、光ビーム6を選択的に開閉するスイッチ(図示せず)が設けられている。【0008】まず、レーザ装置1から出射されたレーザ光2は、光分割器3により複数の光ビームに分割されて各光ファイバ4に入射される。ここでは、レーザ光2が105本の光ビーム6に分割された場合を示すが、分割数は任意であり、また、光ビーム6の分割方向は、1次元方向のみならず、2次元方向にも分割され得る。

【0009】光ファイバ4を通過して出射口5から出射された光ビーム6は、光ファイバ4の開口数NA(Numerical Aperture)に相当した角度で広がる。さらに、光ビーム6は、転写光学系7を介して、任意の倍率に拡大または縮小されて被加工物体8に照射される。

【0010】このとき、被加工物体8の表面は、光ビー 20 ム6の照射エネルギーにより加熱されて溶融し、被加工物体8の被照射部全体が溶融温度まで上昇すると、被加工物体8には穴が形成される。また、被加工物体8または光ビーム6(光ファイバ4または出射口5)を移動させると、被加工物体8が切断されて、任意の加工が施される。

【0011】しかしながら、前述のように、光ビーム6を配列するためのバンドルファイバは、光ファイバ4の入射口に設けられており、また、光ビーム6を開閉するスイッチは、出射口5の付近に設けられているので、被 30加工物体8に対する照射位置を高精度に制御することができない。

【0012】なぜなら、光ファイバ4の入射口の付近で位置決めされた光ファイバ4を、出射口5の付近で正確に位置決めすることができないうえ、出射口5の付近でスイッチの取り付けスペースを確保するために、各出射口5の間隔を小さく設定することができないからである。

【0013】また、被加工物体8に対する加工寸法は、出射口5に設けられた転写光学系7の転写率を変えるこ 40 とにより拡大または縮小可能であるが、スイッチを出射口5の近傍に設けた場合には、バンドルファイバ内で配列された各光ファイバ4の相互間の距離を近づけることができず、数ミクロン[μm]オーダの微細な加工を行うことはできない。

[0014]

【発明が解決しようとする課題】従来のレーザ制御装置は以上のように、光ファイバ4の出射口5から転写光学系7を介して被加工物体8に直接光ビーム6を照射しているので、たとえば1個の光ファイバを用いて複数の穴 50

を加工して記号(数字または文字など)を表記した場

合、1個の穴を加工した後に、光ファィバまたは被加工 物体を移動させる必要があり、加工毎の位置合わせ作業 に多大な時間を要するという問題点があった。

【0015】また、図11のように複数の光ファイバ4を用いて複数の穴加工を行う場合、加工したい記号に応じて、各光ビーム6を開閉するスイツチを設けるスペースを出射口5の周辺に確保する必要があり、各出射口5の間の距離を小さく設定することができないので、数ミクロン [μm] オーダの微細な加工を実現することができないという問題点があった。

【0016】この発明は上記のような問題点を解決するためになされたもので、各光ファイバの出射口をバンドルファイバで位置決めして、光ビームの照射形状を出射口の配列により形成するとともに、各光ファイバの中間部に光ビームの通過を選択的に開閉するスイッチを設けて任意の記号に対応した光ビームを照射することにより、光ビームの照射精度を損なうことなく効果的に照射制御時間を短縮することのできるレーザ制御装置を得ることを目的とする。

[0017]

【課題を解決するための手段】この発明の請求項1に係るレーザ制御装置は、レーザ光を出射するレーザ装置と、レーザ光を複数の光ビームに分割して集光するための光結合器と、光結合器から出射される光ビームを伝送する複数の光ファイバと、各光ファイバの中間部に挿入されて光ビームの光路を選択的に開閉する複数のスイッチと、光ファイバの出射口を所定配列に構成するためのバンドルファイバと、各出射口から出射された光ビームを目標物体に照射するための転写光学系とを備えたものである。

【0018】また、この発明の請求項2に係るレーザ制御装置は、請求項1において、各スイッチを個別に開閉駆動するためのスイッチ制御装置を備え、スイッチ制御装置は、各スイッチの制御情報が格納された記憶手段を有し、制御情報に応じた制御信号を出力するものである。

【0019】また、この発明の請求項3に係るレーザ制 御装置は、請求項1または請求項2において、バンドル ファイバは、光ファイバの出射口を1次元的に配列した ものである。

【0020】また、この発明の請求項4に係るレーザ制 御装置は、請求項1または請求項2において、バンドル ファイバは、光ファイバの出射口を2次元的に配列した ものである。

【0021】また、この発明の請求項5に係るレーザ制 御装置は、請求項3または請求項4において、バンドル ファイバは、複数のバンドルファイバに分割されたもの である。

0 【0022】また、この発明の請求項6に係るレーザ制

5

御装置は、請求項1から請求項5までのいずれかにおい て、各スイッチは、光ビームの光路中に選択的に配置さ れる遮光板と、遮光板を駆動する駆動手段とを有するも のである。

【0023】また、この発明の請求項7に係るレーザ制 御装置は、請求項6において、遮光板は、光ビームの照 射面が全反射ミラーからなり、光ビームの光路中に所定 角度をもって選択的に配置され、駆動手段は、遮光板の 回転軸となる回転シャフトと、回転シャフトを介して遮 光板を回転駆動するモータとを有するものである。

【0024】また、この発明の請求項8に係るレーザ制 御装置は、請求項1から請求項7までのいずれかにおい て、各スイッチは、光ファイバの出射口の所定配列に対 応するように一体的に配列されたものである。

【0025】また、この発明の請求項9に係るレーザ制 御装置は、請求項1から請求項8までのいずれかにおい て、光結合器は、光ファイバの出射口の所定配列に対応 した配列からなる単一のレンズアレイを有し、各光ファ イバの入射口は、レンズアレイの集光点に配置されたも のである。

【0026】また、この発明の請求項10に係るレーザ 制御装置は、請求項1から請求項9までのいずれかにお いて、目標物体は、被加工物体からなるものである。

【0027】また、この発明の請求項11に係るレーザ 制御装置は、請求項1から請求項9までのいずれかにお いて、目標物体は、表示用のスクリーンからなるもので ある。

[0028]

【発明の実施の形態】実施の形態1.以下、この発明の 実施の形態1を図について説明する。図1はスイッチを 30 併用したこの発明の実施の形態1を概略的に示す構成図 であり、1~8は前述(図11参照)と同様のものであ る。また、4Aは光ファイバ4に接続された後段の光フ ァイバである。

【0029】図1において、9は出射口5に設けられた バンドルファイバであり、各光ファイバ4Aの出射口5 を所定配列に構成している。10は光ファイバ4および 4 Aの中間部に設けられた複数のスイッチであり、光ビ ーム6の光路を個別に且つ選択的に開閉する。

制御装置、12はスイッチ制御装置11から各スイッチ 10に出力される制御信号、4Aは各スイッチ10と出 射口5との間に結合されたの後段の光ファイバである。 【0031】スイッチ制御装置11は、各スイッチ10 に対する制御情報が格納された記憶手段を有するパソコ ンなどから構成されており、制御情報に応じた制御信号 12を出力することにより、スイッチ10の開閉を自動 的に制御する。なお、スイッチ制御装置 1 1 が具備され ていない場合には、各スイッチ10を手動で制御するこ ともできる。

【0032】次に、図1に示したこの発明の実施の形態 1の動作について説明する。まず、スイッチ制御装置1 1は、あらかじめ記憶されたプログラムにしたがって制 御信号12を出力し、光ファイバ4および4Aの途中に 配設された各スイツチ10を所定のパターンで開閉制御

【0033】このとき、スイッチ制御装置11内の記憶 装置には、たとえば、加工すべき記号(数字や文字)に 対応する制御信号12があらかじめ格納されているの

して光ビーム6を遮蔽する。

10 で、スイッチ制御装置11からは、加工すべき記号に対 応した制御信号12が発生する。

【0034】これにより、制御信号12に応じた所定の スイッチ10が開閉され、バンドルファイバ9内の各出 射口5から出射される光ビーム6は、オンオフ制御され て、目的とする記号を被加工物体8上に加工することが できる.

【0035】また、各スイッチ10が光ファイバの中間 部 (光ファイバ4と光ファイバ4 Aとの接続部) に配設 されているので、スイッチ10の取り付けスペースを十 分に確保することができる。また、スイッチ10の寸法 20 に制限されずに、出射口5の近傍において、バンドルフ ァイバ9内の各光ファイバ4の相互間距離を最小限に近 づけることができる。

【0036】したがって、スイッチ10を用いても、数 ミクロン [µm]のオーダの微細な記号を加工すること ができる。また、バンドルファイバ9を出射口5に設け ることにより、所定配列の出射口5の間隔を十分に小さ く設定して高精度に構成することができる。

【0037】さらに、マイコンからなるスイッチ制御装 置11を設けることにより、加工対象となる記号に応じ て、あらかじめプログラムされた制御信号12を出力し て、スイッチ10の開閉制御を自動的に行うことができ る。

【0038】実施の形態2.なお、上記実施の形態1で は、バンドルファイバ9の具体的な構成について言及し なかったが、出射口5を1次元的に配列してもよい。

【0039】図2は出射口5を1次元的に配列したこの 発明の実施の形態2の要部を概略的に示す正面図および 側面図であり、(a)は被加工物体8側から見たバンド 【0030】11はスイッチ10の開閉させるスイッチ 40 ルファイバ9の周辺構成を示す正面図、(b)は被加工 物体8およびバンドルファイバ9の周辺構成を示す側面 図である。

> 【0040】図2(a)および(b)において、4~8 は前述(図1参照)と同様のものであり、図示されない 構成は図1に示した通りである。この場合、バンドルフ ァイバ9は、図2(b)のように、中心部において、各 光ファイバ4Aの出射口5を1次元的に縦方向に配置し ている。なお、1次元的配列は、図2(a)のような直 線方向に限らず、円弧方向であってもよい。

50 【0041】次に、図2に示したこの発明の実施の形態

2の動作について説明する。まず、光ビーム6は、バンドルファイバ9内に1次元的に配列された出射口5から出射され、前述のように転写光学系7を介して拡大または縮小されて被加工物体8に照射される。

7

【0042】このとき、光ファイバ4Aの出射口5が1次元的に配列されているので、各光ビーム6は、被加工物体8上に、たとえば、バーコードのように1方向に連続した複数の線、または、1方向に断続した複数の線を加工することができる。

【0043】このように、複数の光ファイバ4Aの出射 10 口5を1次元に配置したバンドルファイバ9を用いることにより、バーコードのような複数の線を短時間に加工するレーザ制御装置を得ることができる。

【0044】実施の形態3.なお、上記実施の形態2では、一体化された単一構成のバンドルファイバ9を用いたが、分割されたバンドルファイバを用いてもよい。図3は分割されたバンドルファイバを用いたこの発明の実施の形態3の要部を概略的に示す側面図であり、4~6および8は前述(図2参照)と同様のものである。

【0045】また、7Aおよび7Bは前述の転写光学系 207に対応しており、9Aおよび9Bはバンドルファイバ9に対応している。この場合、光ビーム6は、分割されたバンドルファイバ9Aおよび9B内の各出射口5から出射され、各転写光学系7Aおよび7Bを介して被加工物体8に照射される。

【0046】すなわち、一方のバンドルファイバ9Aから出射された光ビーム6は、一方の転写光学系7Aを介して被加工物体8の一部に照射され、他方のバンドルファイバ9Bから出射された光ビーム6は、他方の転写光学系7Bを介して被加工物体8の他の部分に照射される

【0047】これにより、被加工物体8の表面、裏面または側面上の2次元的または3次元的に離れた2つの場所に対して、精度を損なうことなく、速やかに且つ同時に加工することができる。

【0048】実施の形態4.また、上記実施の形態2では、光ファイバ4Aの出射口5をバンドルファイバ9内に1次元的に配列したが、任意のキャラクタ記号を表現できるように2次元的に配列してもよい。

【0049】図4は光ファイバ4Aを2次元的に配列し 40 たこの発明の実施の形態3の要部を概略的に示す正面図 および側面図であり、(a)は被加工物体側から見たバンドルファイバ周辺構成を示す正面図、(b)は被加工 物体およびバンドルファイバ周辺構成を示す側面図である。

【0050】図4(a)および(b)において、4および6~8は前述(図2参照)と同様のものである。また、5 Cおよび9 Cは、それぞれ、出射口5およびバンドルファイバ9に対応している。

【0051】この場合、各光ファイバ4Aの出射口5C 50 ために黒い塗料が固着されている。

は、図4(a)のように、バンドルファイバ9C内の中心部に2次元的(たとえば、縦方向に7個、横方向に5個)に配列されている。出射口5Cの2次元配列は、任意数に設定され得ることは言うまでもない。

【0052】次に、図4に示したこの発明の実施の形態 4の動作について説明する。まず、2次元的に配列され たバンドルファイバ9C内の出射口5Cから出射された 光ビーム6は、前述のように転写光学系7を介して被加 工物体8に照射される。

(40053) このとき、光ビーム6は、2次元的(縦方向に7個、横方向に5個)に配列することにより、たとえば、「0」~「9」の数字や任意の文字などの記号を加工することができる。図4(a)においては、黒点で示す数字「4」を加工する場合を示している。

【0054】すなわち、被加工物体8上に数字の「4」を加工する場合、図4(a)内の加工すべき黒点の位置に対応した出射口5Cのみから光ビーム6が出射され、他の出射口5Cからの光ビームはスイッチ10により遮断される。

〇 【0055】このように、バンドルファイバ9C内に出射口5Cを2次元的に配置し、加工すべき記号に対応した形状の各出射口5Cから、被加工物体8に光ビーム6を照射することにより、数字や文字などの任意の記号を同時に加工することができ、高精度で短時間の加工を実現することができる。

【0056】実施の形態5. なお、上記実施の形態1~4では、光ビーム6に対してシャッタとして機能するスイッチ10内の具体的構成について特に言及しなかったが、たとえば、スイッチ10内に移動可能な遮光板を用30 いてもよい。

【0057】図5は遮光板を用いたこの発明の実施の形態5によるスイッチを示す側断面図であり、4、4A、6および10は前述(図1参照)と同様のものである。図5において、スイッチ10の周辺構成は、図1に示した通りなので省略されている。

【0058】13はスイッチ容器、14は光ビーム6の 光路中に挿入された遮光板である。15はスイッチ10 の開閉を行う可動シャフトであり、制御信号12に応答 して矢印方向に駆動される。16はスイッチ容器13お よび遮光板14に形成された冷却水用溝であり、スイッ チ容器13および遮光板14の温度上昇を抑制する。

【0059】17はレーザ光6(破線参照)の光路中に 挿入された集光レンズ(集光光学系)であり、遮光板1 4が介在されない場合にスイッチ10を通過するレーザ 光を集光して、後段の光ファイバ4Aに導入する。

【0060】この場合、遮光板14は、光ビーム6の光路に対して垂直に挿入されており、光ビーム6の吸収性を向上させるため、たとえば、光ビーム6が入射される側の表面が粗く形成されるとともに、反射率を抑制するために思い涂料が固葉されている。

いる。

【0061】また、スイッチ容器13および遮光板14 は、光ビーム6の強度が大きい場合の発熱を抑制するた めに、冷却水用溝16に流れる冷却水(または空気)に より冷却される。したがって、冷却水用溝16は、光ビ -ム6が直接照射される遮光板14と、光ビーム6の反 射光が照射されるスイッチ容器13の上面部とに設けら

【0062】ここでは、冷却水用溝16を遮光板14内 に形成したが、スイッチ容器13上に設けられた冷却水 用溝16と同様に、遮光板14の表面および裏面の少な 10 くとも一方にロー付けされた銅管などにより形成しても よい。

れている。

【0063】次に、図1を参照しながら、図5に示した この発明の実施の形態5の動作について説明する。ま ず、被加工物体8に照射される光ビーム6を遮断する場 合、スイッチ制御装置11は、ビーム遮蔽用の制御信号 12を出力して可動シャフト15を図5内の矢印方向に 移動し、スイッチ10内の遮光板14を光ビーム6に対 して垂直方向から挿入する。

【0064】一方、光ビーム6を遮断しない場合、スイ 20 ッチ制御装置11は、ビーム通過用の制御信号12を出 力して可動シャフト15を図5内の矢印とは逆方向に移 動し、スイッチ10内の遮光板14を光ビーム6から離 脱させる。これにより、光ビーム6は、図5内の破線の ように、集光レンズ17を介して後段の光ファイバ4A に導入され、被加工物体8に照射される。

【0065】可動シャフト15は、光ビーム6を遮蔽 (オフ) するときには、図示されたように光ビーム6の 光路中に配置され、光ビーム6を通過(オン)させると きには、矢印とは逆方向に駆動されて光ビーム6の光路 30 から退避される。これにより、効果的にスイッチ10の 機能を実現することができる。

【0066】実施の形態6.なお、上記実施の形態5で は、スイッチ10内の遮光板14を、光ビーム6の光路 に対して、垂直に配設して移動可能に構成したが、所定 角度で傾斜させて回転可能に配設してもよい。

【0067】図6は遮光板を傾斜配置したこの発明の実 施の形態6によるスイッチを示す側断面図であり、4、 4A、6、10、13、16および17は前述(図5参 照) と同様のものである。また、14Aおよび15A は、それぞれ、遮光板14および可動シャフト15に対 応している。

【0068】図6において、6Aは遮光板14Aによる 光ビーム6の反射ビーム、15Aは遮光板14Aを回転 駆動する回転シャフト、13Aは反射ビーム6Aが照射 されるスイッチ容器13の側壁部である。

【0069】この場合、回転可能な遮光板14Aは、光 ビーム6の光路中に所定角度(たとえば、45°)で挿 入されており、冷却水用溝16は、反射ビーム6Aが照

【0070】遮光板14Aは、光ビーム6を遮蔽すると きには、図示したように、光ビーム6の光路中に配置さ れて光ビーム6を反射させる。また、光ビーム6を通過 させるときには、反時計方向に回転されて光ビーム6の 光路から退避され、光ビーム6を破線のように後段の光 ファイバ4Aに導入する。これにより、前述と同様に、 効果的にスイッチ10の機能を実現することができる。 【0071】また、図6の場合、遮光板14Aは、光フ

ァイバ4から出射された光ビーム6をスイッチ容器13 の側壁部13Aに反射するので、光ファイバ4側に逆行 する光ビーム量を抑制することができ、光ファイバ4の 出射口の温度上昇を前述 (図5参照) の場合よりも抑制 することができる。

【0072】さらに、遮光板14Aとしては、一般に熱 伝導性の高い銅板などを用いるが、アルミ蒸着されたミ ラーや誘電体多層膜で形成された全反射ミラーなどを用 いれば、光ビーム6のほとんどを側壁部13A側に反射 させることができる。したがって、遮光板14Aの温度 が上昇しないので、遮光板14Aにおいて、冷却水用溝 16などの強制冷却用の構造が不要となる。

【0073】なお、上記実施の形態5および6(図5お よび図6参照)では、遮光板14および14Aを光ファ イバ4と集光レンズ17との間に配置したが、集光レン ズ17と後段の光ファイバ4Aとの間に配置してもよ く、前述と同等の作用効果を奏することは言うまでもな 11.

【0074】実施の形態7.また、上記実施の形態5お よび6では、複数のスイッチ10の全体の配列について 言及しなかったが、出射口5の所定配列に対応させて配 列してもよい。図7は複数のスイッチ10を所定配列さ せたこの発明の実施の形態7によるスイッチアレイを示 す側面図であり、4、4A、6および10~17は前述 (図1および図5参照)と同様のものである。

【0075】図7において、複数(たとえば、5個)の スイッチ10は、1次元的に配列されて一体化されてい るが、2次元的に配列されていてもよい。23は各遮光 板14の可動シャフト15に連結された駆動装置であ り、ここでは、単一の駆動装置23が示されているが、 実際には、各可動シャフト15に対応して個別に連結さ れているものとする。

【0076】この場合、各遮光板14は、可動シャフト 15を移動させることにより、図中の手前側から光ビー ム6の光路に対して垂直に挿入される。また、スイッチ 制御装置11から出力される制御信号12は、駆動装置 23内の任意の可動シャフト15を移動させて、遮光板 14の開閉駆動を行う。

【0077】具体的には、可動シャフト15にモータ (図示せず)を接続し、制御信号12をモータに印加す 射されるスイッチ容器13の側壁部13Aに配設されて 50 ることにより遮光板14を駆動することにより、開閉さ

せることができる。

【0078】また、各スイッチ容器13の上面部は、前述のように、冷却水用溝16に冷却水を通すことにより冷却される。特に、スイッチ容器13は、遮光板14からの反射ビームが照射される光ファイバ4の出射口の付近において冷却される。

1 1

【0079】図7のように、複数のスイッチ10を一体化することにより、スイッチ10の全体構成を小形化することができる。

【0080】実施の形態8. なお、上記実施の形態7で 10 は、スイッチ10として遮光板14および可動シャフト 15(図5参照)を用い、各スイッチ10を1次元的に配列したが、スイッチ10として遮光板14Aおよび回転シャフト15A(図6参照)を用い、各スイッチ10を2次元的に配列してもよい。

【0081】図8は複数のスイッチ10を2次元的に配列させたこの発明の実施の形態8によるスイッチアレイを示す側面図および斜視図であり、図8(a)は側面図、図8(b)は斜視図である。

【0082】図8(a)および(b)において、4、4 20 A、6、10~13、14Aおよび15Aは前述(図1 および図6参照)と同様のものであり、集光光学系17 などの図示されない構成は、図1および図6に示した通 りである。また、23Aは前述(図7参照)の駆動装置 23に対応している。

【0083】図8において、複数(たとえば、 5×5 個)のスイッチ10は、2次元的に配列されて一体化されている。24は各駆動装置23A内のモータであり、回転シャフト15Aを回転させて遮光板14Aを回転駆動する。

【0084】この場合、各遮光板14Aは、前述(図6参照)と同様に、回転シャフト15Aの回転位置に応じて、光ビーム6の光路に対して所定角度で挿入される。このとき、回転シャフト15Aは、制御信号12に応答して、モータ24により回転駆動される。

【0085】このように、複数のスイッチ10を2次元的に一体化することにより、スイッチ駆動装置11を各スイッチ10に容易に接続することができ、小形で低価格なスイッチアレイを構成することができる。したがって、小形で低コストのレーザ制御装置を実現することが 40できる。

【0086】なお、上記実施の形態1~8では、光ビーム6を開閉するためのスイッチ10として、可動部を有する機械的なスイツチを用いたが、KH2PO₄(一般に、KDPと略称される)などの電気光学素子または電気的スイッチを用いてもよく、前述と同様の作用効果を奏することは言うまでもない。

【0087】実施の形態9.また、上記実施の形態1~ てもよい。さらに、紫外8では、光結合器3(図1参照)の具体的構成について で波長が変化する波長可言及しなかったが、出射口5の所定配列に対応した配列 50 と同等の効果を奏する。

12 からなる単一のレンズアレイにより光結合器3を構成してもよい。

【0088】図9は単一のレンズアレイにより構成したこの発明の実施の形態9による光結合器を示す構成図であり、1~4および6は前述(図1参照)と同様のものである。図9において、4aは各光ファイバ4の入射口、28は光結合器3内で分割器として機能するレンズアレイである。

【0089】図10は図9内のレンズアレイ28を拡大して示す斜視図である。図10において、29はレンズアレイ28を構成する複数の凸レンズであり、2次元的に配列された任意の分割数(たとえば、図4(a)のように、縦方向に7分割、横方向に5分割)を有している。

【0090】レーザ光2を2次元的に分割する各凸レンズ29は、効率的に光ビーム6を集光するために一体化されており、バンドルファイバ9の光ファイバ数に対応した配列を有している。また、各光ファイバ4の入射口4aは、レンズアレイ28内の各凸レンズ29の集光点に配置されている。

【0091】次に、図9および図10に示したこの発明の実施の形態9の動作について説明する。図9において、まず、レンズアレイ28は、レーザ装置1から出射されたレーザ光2を複数の光ビーム6に分割して集光する。

【0092】このとき、光ファイバ4の入射口4aは、各光ビーム6の集光点に配置されているので、各光ビーム6は各光ファイバ4内に確実に入射される。したがって、ほぼ100%のレーザ光2を高効率に分割して、光30 ビーム6として伝送することができる。

【0093】このように、単一のレンズアレイ28によりレーザ光2を分割して集光することにより、レーザ伝送効率が高く且つ低コストな光結合器3を構成することができる。したがって、高効率で低コストなレーザ制御装置を得ることができる。

【0094】実施の形態10.なお、上記実施の形態1~9では、レーザ制御装置を加工装置に適用した場合について説明したが、他の用途に適用してもよい。

【0095】たとえば、出射口5から出射される光ビーム6をスクリーン(図示せず)に照射すれば、任意の記号を表示するレーザ表示装置として適用した場合に、高精度且つ高速な表示を行うことができ、前述と同等の作用効果を奏する。

【0096】また、レーザ装置1として、YAGレーザ、半導体レーザ、銅蒸気レーザ、エキシマレーザを用いた場合について説明したが、たとえば、YAGレーザなどの固体レーザの2倍波を利用するレーザ装置を用いてもよい。さらに、紫外線領域から赤外線領域までの間で波長が変化する波長可変レーザを用いてもよく、前述と同等の効果を奏する

7/24/2006, EAST Version: 2.0.3.0

[0097]

【発明の効果】以上のようにこの発明の請求項1によれ ば、レーザ光を出射するレーザ装置と、レーザ光を複数 の光ビームに分割して集光するための光結合器と、光結 合器から出射される光ビームを伝送する複数の光ファイ バと、各光ファイバの中間部に挿入されて光ビームの光 路を選択的に開閉する複数のスイッチと、光ファイバの 出射口を所定配列に構成するためのバンドルファイバ と、各出射口から出射された光ビームを目標物体に照射 するための転写光学系とを備え、各光ファイバの出射口 10 をバンドルファイバで位置決めして、光ビームの照射形 状を出射口の配列により形成するとともに、各光ファイ バの中間部に光ビームの通過を選択的に開閉するスイッ チを設けて任意の記号に対応した光ビームを照射するよ うにしたので、光ビームの照射精度を損なうことなく効 果的に照射制御時間を短縮することのできるレーザ制御 装置が得られる効果がある。

【0098】また、この発明の請求項2によれば、請求 項1において、各スイッチを個別に開閉駆動するための スイッチ制御装置を備え、スイッチ制御装置は、各スイ 20 ッチの制御情報が格納された記憶手段を有し、制御情報 に応じた制御信号を出力するようにしたので、スイッチ の開閉制御を自動的に行うことのできるレーザ制御装置 が得られる効果がある。

【0099】また、この発明の請求項3によれば、請求 項1または請求項2において、バンドルファイバは、光 ファイバの出射口を1次元的に配列したので、バーコー ドなどの1次元記号に対応した光ビームを高精度且つ高 速に照射することのできるレーザ制御装置が得られる効 果がある。

【0100】また、この発明の請求項4によれば、請求 項1または請求項2において、バンドルファイバは、光 ファイバの出射口を2次元的に配列したので、文字など の2次元記号に対応した光ビームを高精度且つ高速に照 射することのできるレーザ制御装置が得られる効果があ

【0101】また、この発明の請求項5によれば、請求 項3または請求項4において、バンドルファイバは、複 数のバンドルファイバに分割されたので、複数の部分に 対して光ビームを高精度且つ高速に照射することのでき 40 るレーザ制御装置が得られる効果がある。

【0102】また、この発明の請求項6によれば、請求 項1から請求項5までのいずれかにおいて、各スイッチ は、光ビームの光路中に選択的に配置される遮光板と、 遮光板を駆動する駆動手段とを有するので、光ビームを 確実に開閉することのできるレーザ制御装置が得られる 効果がある。

【0103】また、この発明の請求項7によれば、請求 項6において、遮光板は、光ビームの照射面が全反射ミ

14

択的に配置され、駆動手段は、遮光板の回転軸となる回 転シャフトと、回転シャフトを介して遮光板を回転駆動 するモータとを有するので、遮光板の発熱を抑制するこ とのできるレーザ制御装置が得られる効果がある。

【0104】また、この発明の請求項8によれば、請求 項1から請求項7までのいずれかにおいて、各スイッチ は、光ファイバの出射口の所定配列に対応するように一 体的に配列されたので、さらに小形化を実現したレーザ 制御装置が得られる効果がある。

【0105】また、この発明の請求項9によれば、請求 項1から請求項8までのいずれかにおいて、光結合器 は、所定配列に対応した配列からなる単一のレンズアレ イを有し、各光ファイバの入射口は、レンズアレイの集 光点に配置されたので、高効率に光ビームに分割するこ とのできるレーザ制御装置が得られる効果がある。

【0106】また、この発明の請求項10によれば、請 求項1から請求項9までのいずれかにおいて、目標物体 は、被加工物体からなるので、高精度且つ高速なレーザ 加工が可能なレーザ制御装置が得られる効果がある。

【0107】また、この発明の請求項11によれば、請 求項1から請求項9までのいずれかにおいて、目標物体 は、表示用のスクリーンからなるので、高精度且つ高速 なレーザ表示が可能なレーザ制御装置が得られる効果が ある。

【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の実施の形態1を概略的に示す構成 図である。

【図2】 この発明の実施の形態2の要部を概略的に示 す正面図および側面図である。

30 【図3】 この発明の実施の形態3の要部を概略的に示 す側面図である。

【図4】 この発明の実施の形態4の要部を概略的に示 す正面図および側面図である。

【図5】 この発明の実施の形態5によるスイッチを示 す側断面図である。

【図6】 この発明の実施の形態6によるスイッチを示 す側断面図である。

【図7】 この発明の実施の形態7によるスイッチアレ イを示す側面図である。

【図8】 この発明の実施の形態8によるスイッチアレ イを示す側面図および斜視図である。

【図9】 この発明の実施の形態9による光結合器を示 す構成図である。

【図10】 図9内のレンズアレイを拡大して示す斜視 図である。

【図11】 従来のレーザ制御装置を概略的に示す構成 図である。

【符号の説明】

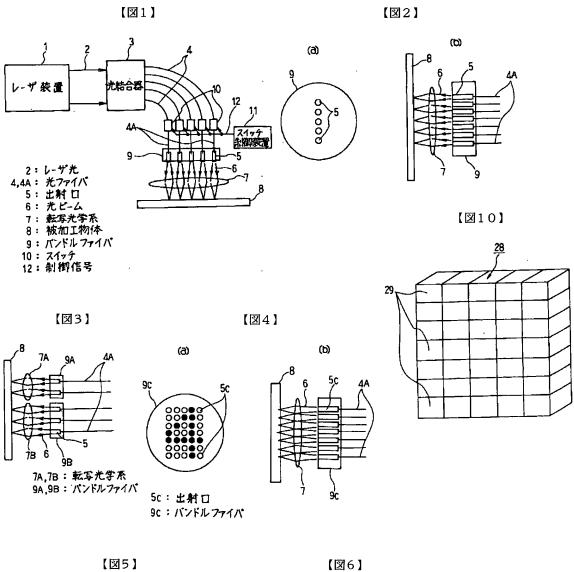
1 レーザ装置、2 レーザ光、3 光結合器、4、4 ラーからなり、光ビームの光路中に所定角度をもって選 50 A 光ファイバ、4a入射口、5、5C 出射口、6

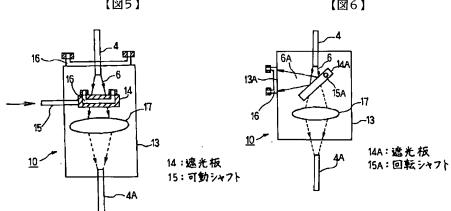
15

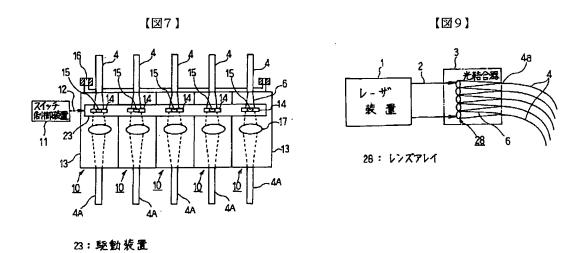
光ビーム、7、7A、7B 転写光学系、8被加工物体、9、9A、9B,9C バンドルファイバ、10スイッチ、11 スイッチ制御装置、12 制御信号、

14、14A 遮光板、15 可動シャフト、15A 回転シャフト、23、23A 駆動装置、24 モータ、28レンズアレイ。

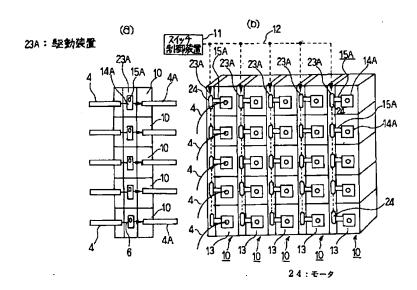
16







【図8】



【図11】 2 大統合器 表置

5 6

7/24/2006, EAST Version: 2.0.3.0